# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-308636

(43) Date of publication of application: 23.10.2002

(51)Int.Cl.

CO3B 33/06

B26F 3/00

(21)Application number : 2002-015072

(71)Applicant : UNIV NIHON

(22)Date of filing:

24.01.2002

(72)Inventor: HASHIMOTO JUN

(30)Priority

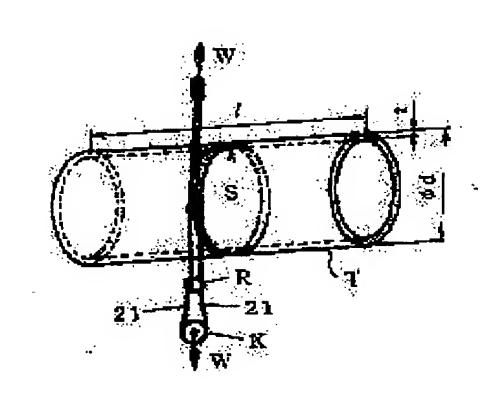
Priority number: 2001024098 Priority date: 31.01.2001 Priority country: JP

# (54) METHOD FOR CUTTING CYLINDRICAL CERAMIC

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid the defects of cutting by a blade, to prevent the generation of chips or noises, to improve work environment, to easily and rapidly or instantly cut a cylindrical ceramic by a small force, and to obtain a smooth cut surface when the cylindrical ceramic is cut.

SOLUTION: A method for cutting the cylindrical ceramic comprises forming notched grooves S in the direction orthogonal to the shaft center direction at desired cutting positions of the cylindrical ceramic, and then inducing a tensile stress at the notched grooves S of the cylindrical ceramic so as to cut the cylindrical ceramic at the positions of the notched grooves. Notched grooves are provided at the outer peripheral surface of the cylindrical ceramic and a side pressure p is applied at appropriate intervals. Or, a notched groove S is provided at the inner peripheral surface of the cylindrical ceramic, and a side pressure (p) is applied to the outer peripheral surface at the position of the notched groove. The side pressure (p) is applied by winding a wire 21 around the cylindrical ceramic.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

20.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2002-308636 (P2002-308636A)

(43)公開日 平成14年10月23日(2002.10.23)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

 $\mathbf{F}$  I

テーマコート\*(参考)

C 0 3 B 33/06 B 2 6 F 3/00

CO3B 33/06

3 C 0 6 0

B 2 6 F 3/00

Z 4G015

# 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願2002-15072(P2002-15072)

(22)出願日

平成14年1月24日(2002.1.24)

(31)優先権主張番号 特願2001-24098 (P2001-24098)

(32) 優先日

平成13年1月31日(2001.1.31)

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 899000057

学校法人 日本大学

東京都千代田区九段南四丁目8番24号

(72)発明者 橋 本 純

福島県郡山市田村町徳定字中河原1 日本

大学 工学部 機械工学科内

(74)代理人 100074170

弁理士 秋山 修

Fターム(参考) 30060 AA08 CA10

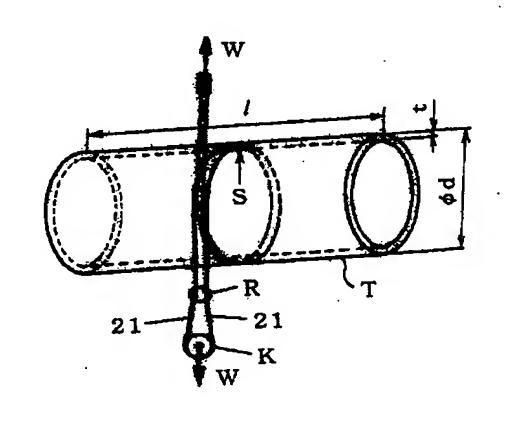
4C015 FA03 FB03 FC10 FC11

#### 円筒状のセラミックスの切断方法 (54)【発明の名称】

#### (57)【要約】

【課題】 円筒状のセラミックスの切断に関して、刃物 による切断の欠点を解消する。切屑や騒音の発生を防止 する。作業環境を良好にする。簡易迅速に円筒状のセラ ミックスを小さな力で一瞬に切断する。切断面を平滑と する。

【解決手段】 円筒状のセラミックスの所望とする切断 位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝s,Sを形成 し、次いで円筒状のセラミックスの切欠溝 s, Sに引張 応力を誘起させることにより円筒状のセラミックスを前 記切欠溝 s, S位置で切断する。切欠溝 sを円筒状のセ ラミックスの外周面に設け、適宜の間隔を置いて側圧p を負荷する。また切欠溝Sを円筒状のセラミックスの内 周面に設け、切欠溝S位置の外周面に側圧pを負荷す る。ワイヤー21を円筒状のセラミックスに巻き回して 側圧pを与える。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 円筒状のセラミックスを所望とする切断 位置でセラミックスの軸心方向と直交する方向に切断す る円筒状のセラミックスの切断方法において、

前記円筒状のセラミックスの所望とする切断位置の軸心 方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いでセラミッ クスの切欠溝に引張応力を誘起させることによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断することを特徴とする円 筒状のセラミックスの切断方法。

【請求項2】 円筒状のセラミックスを所望とする切断 10 位置でセラミックスの軸心方向と直交する方向に切断する円筒状のセラミックスの切断方法において、

前記円筒状のセラミックスの外周面の所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いでセラミックスの切欠溝から適宜の間隔を置いてセラミックスの外周面に側圧を負荷することによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断することを特徴とする円筒状のセラミックスの切断方法。

【請求項3】 円筒状のセラミックスを所望とする切断 位置でセラミックスの軸心方向と直交する方向に切断す 20 る円筒状のセラミックスの切断方法において、

前記円筒状のセラミックスの内周面の所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いでセラミックスの切欠溝位置の外周面に側圧を負荷することによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断することを特徴とする円筒状のセラミックスの切断方法。

【請求項4】 前記セラミックスの外周面にワイヤーを 巻き回し、該ワイヤーに引張荷重を負荷してセラミック スの外周面に側圧を負荷することを特徴とする請求項 1、請求項2及び請求項3の何れかに記載の円筒状のセ 30 ラミックスの切断方法。

【請求項5】 円筒状のセラミックスを所望とする切断 位置でセラミックスの軸心方向と直交する方向に切断す る円筒状のセラミックスの切断方法において、

前記円筒状のセラミックスの外周面の所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いで、セラミックスを被覆するヤング率の小さい側圧伝達筒と側圧負荷手段を有する圧力容器とを備えるディスキング装置にセラミックスを挿入し、前記切欠溝の位置が前記側圧伝達筒の端面から外方に適宜の長さ突出するよりにセラミックスを配置し、前記ディスキング装置の側圧負荷手段によりセラミックスの外周面の切欠溝から適宜の間隔を置いた位置に側圧を負荷することによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断することを特徴とする円筒状のセラミックスの切断方法。

# 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、円筒状のセラミックスの切断方法に関し、更に詳細に説明すると、円筒状のセラミックスを所望とする切断位置でセラミックスの 50

軸心方向と直交する方向に切断する円筒状のセラミックスの切断方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来より、機械や電子機器には各種のセラミックスが使用され、これらのセラミックスの切断は主としてダイヤモンド砥石や鋸刃等の刃物により行われている。この刃物による切断の場合には切屑や騒音を発生させ、作業環境を悪化させる虞れを有し、また切断までにかなりの時間とエネルギーを要し、刃物の摩耗による損傷も著しく経済性に欠けるものであった。

【0003】また、円筒(中空)状及び円柱(中実)状のセラミックスをディスキング装置に配置してセラミックスに側圧(外周面からの絞込み圧)を負荷し、セラミックスを側圧による破壊を利用したディスキングと呼ばれる切断方法により切断することがすでに開発されている。

【0004】このディスキングによる切断方法は、図1に示すディスキング装置1により行われる。このディスキング装置1は圧力容器3の内部に円筒状のセラミックス5が挿入されてる。この円筒状のセラミックス5は外径d、肉厚tである。両端開放状態の円筒状のセラミックス5の外周面にセラミックス5の軸心方向と直交する方向に複数の切欠溝7を適宜の間隔で、例えば間隔bで設け、このセラミックス5の外周面を側圧伝達筒9で被覆する。この側圧伝達筒9はセラミックス5よりもヤング率が非常に小さいアクリル樹脂等から形成されている。

【0005】また圧力容器3の圧力負荷口11を挟んで左右一対のOリング13,13が側圧伝達筒9の外周の両端に設けられ、この左右一対のOリング13,13間に前記側圧伝達筒9を保持するカラー15が設けられ、更にそれらの位置決めをする保持環17と前記圧力容器3の外側に圧力の漏れを防止するための螺子19が設けられている。

【0006】斯かるディスキング装置1の構成において、圧力容器3の圧力負荷ロ11より圧力容器3の内部に内圧Pを負荷すれば、セラミックス5は両端開放の状態で側圧を受け、側圧がある値に達することにより左右一対の0リング13,13間の1つの切欠溝7を通る断面で亀裂が進展し切断する。更に側圧を負荷すればセラミックス5は別の切欠溝7を通る断面で順次切断する。この場合のセラミックス5の切断面は平滑である。これがディスキングによる切断である。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】セラミックスの切断法として、従来から行われているダイヤモンド砥石や鋸刃等の刃物による切断法の欠点である切屑や騒音の発生を防止し、また切断までの時間とエネルギーを僅少にすると共に、刃物の摩耗による損傷を防止した円筒状のセラミックスの切断法の開発を行う。一方、前記ディスキン

グは円筒(中空)状のみならず円柱(中実)状のセラミックスの切断において、上記欠点を解消したセラミックスの切断を可能にしている。しかし、このときの切断圧力は高圧であることから、できるだけ低圧で切断を可能とする切断法の開発が望まれる。また前記ディスキングはセラミックスの大きさに適する圧力容器を必要とすることからセラミックスの大きさに関わらず、どのような大きさにも対応できる切断法の開発も望まれる。

【0008】本発明の目的は、前記課題に鑑みてなされたもので、円筒状のセラミックスに側圧(外周からの絞 10込み圧)を加えて小さな力で切断を可能にし、また種々の外径の大きさにも適する切断を可能にすることであって、切断では破壊時に発生する亀裂の進展を積極的に切断に利用することにより、刃物による切断法の欠点を解消し、切屑や騒音を発生させる虞れがなく、作業環境を悪化させる虞れがなく、簡易迅速に一瞬で切断することができ、切断面が平滑で経済性に優れた円筒状のセラミックスの切断方法を提供するものである。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は上述せる課題に 20 鑑みてなされたもので、本発明の請求項1に記載の円筒 状のセラミックスの切断方法は、円筒状のセラミックスを所望とする切断位置でセラミックスの軸心方向と直交する方向に切断する円筒状のセラミックスの切断方法において、前記円筒状のセラミックスの所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いでセラミックスの切欠溝に引張応力を誘起させることによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断することを特徴とする。

【0010】また、本発明の請求項2に記載の円筒状の 30 セラミックスの切断方法は、円筒状のセラミックスを所望とする切断位置でセラミックスの軸心方向と直交する方向に切断する円筒状のセラミックスの切断方法において、前記円筒状のセラミックスの外周面の所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いでセラミックスの切欠溝から適宜の間隔を置いてセラミックスの外周面に側圧を負荷することによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断することを特徴とする。

【0011】また、本発明の請求項3に記載の円筒状のセラミックスの切断方法は、円筒状のセラミックスを所 40 望とする切断位置でセラミックスの軸心方向と直交する方向に切断する円筒状のセラミックスの切断方法において、前記円筒状のセラミックスの内周面の所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いでセラミックスの切欠溝位置の外周面に側圧を負荷することによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断することを特徴とする。

【0012】また、本発明の請求項4に記載の円筒状の セラミックスの切断方法は、前記セラミックスの外周面 にワイヤーを巻き回し、該ワイヤーに引張荷重を負荷し 50 てセラミックスの外周面に側圧を負荷することを特徴と する。

【0013】また、本発明の請求項5に記載の円筒状のセラミックスの切断方法は、円筒状のセラミックスを所望とする切断位置でセラミックスの朝い方向と直交する方向に切断する円筒状のセラミックスの切断方法におりて、前記円筒状のセラミックスの外周面の所望とするりで、前記円筒状のセラミックスを被覆するヤング率の小さい側圧伝達筒と側圧負荷手段を有する圧力容器とを備えるディスキング装置にセラミックスを挿入し、前記切欠構の位置が前記側圧伝達筒の端面から外方に適宜の長さ突出するようにセラミックスを配置し、前記ディスキング装置の側圧負荷手段によりセラミックスの外周面の切欠構から適宜の間隔を置いた位置に側圧を負荷することによりセラミックスを前記切欠構位置で切断することを特徴とする。

#### [0014]

【発明の実施の形態】以下本発明に係る円筒状のセラミ ックスの切断方法を図面を参照して詳述する。図2に は、本発明に係る円筒状のセラミックスの切断方法の概 略が示されており、TはY-Y断面で切断しようとする 外径 d (肉厚 t) が一定の円筒状のセラミックスであ る。この円筒状のセラミックスTのA-B部分の外周に 沿って側圧 p (外周面からの絞込み圧)を負荷すると円 筒状のセラミックスTの外径dはd'に減少するが、側 圧を受けていないC-D部分は最初の状態を保つ。この とき円筒状のセラミックスTには外径 d の変化に比例し た応力が自動的に発生し、B-C部分における円筒状の セラミックスTの外表面の一部に引張応力が誘起する。 【0015】一方、セラミックスは圧縮に強く引張りに 弱いのが特徴である。いま、所望する切断位置のY-Y 断面における円筒外周線上の一部にガラス切り等の工具 により切欠き s を設けているものとし、さらにその切欠 きsの位置がB-C部分にあるものとする。この状態で 側圧 p がある値に達すると、応力集中により切欠き s か

ミックスTの切断である。 【0016】ガラスはオールドセラミックスと呼ばれ、一種のセラミックスである。尚、本実施の形態ではオールドセラミックスに本発明を適用した場合につき説明するが、同様にニューセラミックスにも適用することができるものである。ここではガラス円筒とガラス瓶を上述の切断法を利用して切断した実施例について分けて述べる。

ら引張破壊によるき裂が発生し、円筒状のセラミックス

Tは切欠き s を通り、所望する切断位置のY-Y断面で

一瞬にして分割される。これがここで言う円筒状のセラ

# [0017]

【実施例1】ディスキング装置1は図1に示しているものであり、円筒状のセラミックス5としての切断しよう

とするガラス円筒はパイレックス(登録商標)ガラスからなる外径  $d=60\,\mathrm{mm}$ 、肉厚  $t=4.5\,\mathrm{mm}$ のものである。また側圧伝達筒  $9\,\mathrm{tx}$  1/2 1

【0018】そして切欠き s の位置を側圧伝達筒 9 の端面から 6 mmの間隔を置いた位置にし、更に上述の図 2 に示すように円筒の外周面に側圧を静的に負荷すると、円 10 筒は側圧 P = 1 8 M P a でピンという微弱音を発して切欠き s を通る横断面で切断された。その切断面は平滑で鏡面となっている。尚、円筒端面から切欠き s までの長さを変えても切欠き s を通り正確に切断されると共に切断面も極めて良好であった。また切断時の側圧を P a で表すと、切断圧力 P a は軸長にかかわらず約一定値を示した。

【0019】円筒状のセラミックスTの外周に設けた切欠きsの位置を前記側圧伝達筒9の端面から外方にある長さx、例えば、x=3m $\sim 1$ 0mmとして円筒状のセラミックスTを配設した。尚、図3(a)にx=3m $\sim 1$ 0mmとした場合の試験結果を示す。ここでPaは切断圧力であり、 $\delta$ は切断面の状態を示すものである。

【0020】図3(b)に示すものはx=3mmの場合の切断面の状態であり、このときの切断面は平滑とはならず、外周から内部に入り込んでる。ここでその入り込んだ最大距離を $\delta$ で表す。切断面の状態には2種類のものがあることから、外周から内部に入り込んだものをaで示し、逆に外周から内部に突出したものをbで示す。この切断面の状態を図3(a)の備考欄に示す。図3

(a) に示す試験結果から、x=6mmのデータを見ると、切断圧力 P a 及び  $\delta$  の絶対値が最小値を示しており、x=6mmとするのが切断に適していることが判る。【0 0 2 1】

【実施例2】ここではワイヤー21を用いて円筒状のセラミックスとしてのガラス瓶Tを切断した実施例について述べる。尚、本実施の形態では線状体としてのワイヤーを用いたが、他の線状体を用い、または帯状体等を用いてもよい。図4に示す如く、準備したワイヤー21は直径約4mmからなるスチール製のワイヤーであり、また 40ガラス瓶T (外径65mm、肉厚3mm、高さ140mm) に切欠きsを市販のガラス切りでガラス瓶Tの外部底面から60mmの位置の外表面に軸心方向と直角に長さ約3mmに設けて切断位置を指定した。

【0022】そして、図4に示すようにガラス瓶Tの外表面に1本のワイヤー21を二重にして巻き回し、ワイヤー21の交差時に一方を二重のワイヤー21の間に通し、そのワイヤー21の両端を夫々反対方向に引張るためワイヤー21に引張荷重Wを試験機により静的に負荷した。この時の切欠きsとワイヤー21との間隔はx=50

6 mmとした。ガラス瓶Tは外周面に沿って側圧が負荷され、引張荷重W=2.94kNでピッシィという微弱音を発して切欠きsを通る横断面で切断された。このワイヤー21を用いる場合には、ワイヤー21が破断しない限り、ガラス瓶Tの外径に関わらずどのような大きさの円筒状のセラミックスTでも容易に切断することができるものである。

6

#### [0023]

【比較例】次に、試験片として同一寸法のガラス円筒を6本準備し、ディスキング法とディスキング装置による本発明の切断方法の両者で前記6本のガラス円筒を図1に示すディスキング装置1を用いて2等分して、そのときの切断圧力を夫々求めた。尚、本発明の切断方法による側圧伝達筒の端面から切欠きまでの距離はx=6mmとした。

【0024】またガラス円筒は、外径d=60mm、肉厚t=4.5mm、軸長150mmのパイレックス(登録商標)ガラスを用いた。また側圧伝達筒はポリエチレンからなり、外径68mm、肉厚3.5mm、軸長49mmのものを用いた。更にガラス円筒の軸長を2等分するように、切欠きを市販のガラス切りでガラス円筒の外表面に軸心方向と直角に長さを3mm一定となるように設けて実験を行った。実験により得られた両者の切断圧力の結果を表1と表2に示す。

[0025]

#### 【表1】

ディスキング法による切断圧力Pa

試験片	Pa' (MPa)	
11	45.1	
1 2	49.0	47.1
1 3	47.1	

[0026]

#### 【表 2】

30

本発明の切断方法による切断圧力Pa

試験片	Pa (MPa)	
2 1	18.6	
2 2	17. 7 17. 7	
2 3	16.7	

【0027】上記表1及び表2より明らかなように、本発明の切断方法による切断圧力はディスキング法のものと比較して4割弱小さく、本発明の切断方法ではガラス円筒を小さい切断圧力で切断することができる。

【0028】次いで、本発明の異なる実施の形態を図5 及び図6を参照して説明する。この実施の形態では、図 2に示した円筒状のセラミックスTの外周に設けた切欠 きsの位置をセラミックスTの内周に設けたことを特徴 とするものである。

) 【0029】先ず、図5を参照して切断原理を説明する

• 6

と、TはY-Y断面で切断しようとする外径d(肉厚t)が一定の円筒状のセラミックスである。いまY-Y断面を通る円筒状のセラミックスTの外周線上に側圧pを負荷すると、円筒状のセラミックスTの直径dはd~に減少するが、側圧を受けていない部分は最初の状態を保つ。このため円筒状のセラミックスTには外径dの変化に比例した応力が発生し、Y-Y断面における円筒内周線上の軸心方向に最大引張応力が誘起する。

【0030】いま、円筒状のセラミックスTの切断する位置であるY-Y断面における円筒内周線上の一部に、ガラス切り等の工具により切欠きSを設ける。この状態で円筒状のセラミックスTに側圧pを負荷すると、円筒状のセラミックスTの切欠きS部には、最大引張応力のみならず切欠きSによる応力集中が重畳されるため、側圧pがある値に達すると切欠きSから亀裂が発生すると共に、この亀裂が伝播して円筒状のセラミックスTは所望とする位置のY-Y断面で一瞬に切断される。

【0031】前記切断原理を用いた円筒状のセラミックスTの切断方法を図6に示す。尚、図4に示すと同様の方法を用いることができる。本実施の形態では、図6に 20示す如く、Tは外径d、肉厚t、軸長1の円筒状のセラミックスである。円筒状のセラミックスTの切断位置における円筒内周面には切欠きSを予め設けておく。

【0032】円筒状のセラミックスTの切断位置である切欠きSを通る円筒外周線上に、1本のワイヤー21を二重にして図4に示すと同様に巻き回す。このとき側圧が円筒外周面に均一に負荷されるように滑車Kを用いている。また巻き回したワイヤー21が拡がらないように、即ち図5に示すような線上の側圧pが負荷されるようにリングRを利用してワイヤー21を配置する。

\*【0033】この状態で、ワイヤー21の上端と、下端の滑車K間に引張荷重Wを負荷し、引張荷重Wがある値に達すると、前述した切断原理により亀裂が切欠きS部より発生すると共に、この亀裂が伝播して円筒状のセラミックスTは切欠きSを通る横断面で一瞬にして切断される。尚、ワイヤー21の太さは適宜増減させることができる。

8

[0034]

【実施例3】この実施例3では円筒状のセラミックスTとしてのガラス円筒につき切断を試みた。切断しようとするガラス円筒はパイレックス(登録商標)ガラスからなり、切断では軸長を二等分するように円筒中央の位置に内周に沿って長さ約3mmの切欠きSを円筒内周面に市販のガラス切りで設けた。

【0035】次いで、図6に示す如く、鋼製のリングRと滑車Kを利用して直径1.5mmのスチールワイヤー21をガラス円筒に巻き回し、引張荷重Wを静的に負荷し、ガラス円筒の切断時の引張荷重、即ち切断荷重Waとガラス円筒の切断状態を調べた。

【0036】表3に外径d=40m、軸長1=80mを一定にして、肉厚tのみを変化させて、ガラス円筒を中央で二等分したときの切断結果を示す。切断は同一寸法のガラス円筒を3本準備し、切断荷重Waとしてはその平均で示している。ガラス円筒は表3の切断荷重Waに達したとき、ピシッという微弱音を発して切欠きSを通る横断面で一瞬に切断された。その切断面は平滑で鏡面となっていて、本発明の切断方法では切断時に切り屑の発生がない。

[0037]

【表3】

肉厚 t を変えたときの切断結果

試験片	t (mm)	Wa (N)	
11	,	300	
1 2	1. 5	350	300
1 3		250	
2 1		450	
2 2	2.0	450	467
2 3		500	
3 1		600	
3 2	3. 2	5 5 0	600
3 3		650	
4 1		650	
4 2	4. 0	600	667
4 3		7 5 0	

【0038】ガラス円筒の切断荷重Waは表3に示すように肉厚tに依存し、肉厚tを増すと切断荷重Waも増すが、ガラス円筒の切断面は肉厚tにかかわらず、何れも極めて良好であった。

【0039】次に、表4に肉厚t=3.2mm、軸長1= 50

80mmを一定にして、ガラス円筒の外径 d のみを変化させてガラス円筒を中央で 2 等分したときの切断結果を示す。切断は同一寸法のガラス円筒を 3 本準備し、切断荷重W a としてはその平均で示している。ガラス円筒は表4の切断荷重W a で切欠き S を通る横断面で一瞬に切断

9

\*【表4】

された。 【0040】

外径はを変えたときの切断結果

試験片	d (mm)	Wa (N)		
1 i		3 7 0		
1 2	2 0	380	377	
1 3		380		
2 1		470		
2 2	4 0	450	483	
2 3		5 3 0		
3 1		620		
3 2	60	5 5 0	588	
3 3		595		
4 1		650		
4 2	80	650	653	
4 3		6 6 0		

【0041】表4の切断結果から明らかなように、ガラス円筒の切断荷重Waは外径dに依存し、外径dを大きくすると切断荷重Waが増大するが、ガラス円筒の切断 20面は外径dにかかわらず、何れも極めて良好であった。

#### [0042]

【実施例4】この実施例4では円筒状のセラミックスTとしてのガラス瓶につき切断を試みた。切断しようとするガラス瓶は外径77mm、肉厚4mm、高さ290mmの焼酎用のものと、外径67mm、肉厚3mm、高さ195mmの日本酒用のものである。ガラス瓶の場合には容器の内周面にガラス切りで切欠きSを設けることが困難な場合がある。本実施の形態では、切断を希望する位置に、ガラス切りで切欠きSを設ける代わりに、直径2mmのドリルのによりガラス瓶に貫通する横穴を穿設した。このとき横穴の位置はガラス瓶の外部底面から前者では90mmであり、後者では40mmであった。尚、横穴の大きさは適宜増減することができ、また長穴とすることもできる。

【0043】次いで、図6に示すと同様に、鋼製のリングRと滑車Kを利用して直径1.5mのスチールワイヤー21をガラス瓶に巻き回し、引張荷重Wを静的に負荷した。両者のガラス瓶は何れも横穴を通る横断面で一瞬に切断された。ガラス瓶の切断時の切断荷重Waは前者でWa=1200Nであり、後者でWa=1110Nで 40あった。両者のガラス瓶は所望とする位置で切断されたばかりでなく、切断面も極めて良好であった。

#### [0044]

【発明の効果】以上が本発明に係る円筒状のセラミックスの切断方法の実施の形態であるが、本発明の請求項1に記載の円筒状のセラミックスの切断方法によれば、円筒状のセラミックスの所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いでセラミックスの切欠溝に引張応力を誘起させることによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断するので、刃物による切断の欠50

点を解消し、切屑や騒音を発生させる虞れがなく、作業環境を悪化させる虞れがなく、簡易迅速に円筒状のセラミックスを小さな力で一瞬に切断することができ、平滑な切断面を得ることができる。

【0045】本発明の請求項2に記載の円筒状のセラミックスの切断方法によれば、円筒状のセラミックスの外周面の所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いでセラミックスの切欠溝から適宜の間隔を置いてセラミックスの外周面に側圧を負荷することによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断するので、刃物による切断の欠点を解消し、切屑や騒音を発生させる虞れがなく、作業環境を悪化させる虞れがなく、簡易迅速に円筒状のセラミックスを小さな力で一瞬に切断することができ、平滑な切断面を得ることができる。 【0046】本発明の請求項3に記載の円筒状のセラミ

【0046】本発明の請求項3に記載の円筒状のセラミックスの切断方法によれば、円筒状のセラミックスの内周面の所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に切欠溝を形成し、次いでセラミックスの切欠溝位置の外周面に側圧を負荷することによりセラミックスを前記切欠溝位置で切断するので、切欠きを設けた切断位置と側圧を負荷する位置とを一致させることにより簡易迅速に切断作業を行うことができ、刃物による切断の欠点を解消し、切屑や騒音を発生させる虞れがなく、作業環境を悪化させる虞れがなく、簡易迅速に円筒状のセラミックスを小さな力で一瞬に切断することができ、平滑な切断面を得ることができる。

【0047】本発明の請求項4に記載の円筒状のセラミックスの切断方法によれば、前記セラミックスの外周面にワイヤーを巻き回し、該ワイヤーに引張荷重を負荷してセラミックスの外周面に側圧を負荷するので、どのような外径の円筒状のセラミックスにも対応することができる。また内周面に切欠溝を形成した場合には、切欠きを設けた切断位置とワイヤーの巻き回し位置とが一致

し、簡易迅速に切断作業を行うことができる。

【0048】本発明の請求項5に記載の円筒状のセラミ ックスの切断方法によれば、円筒状のセラミックスの外 周面の所望とする切断位置の軸心方向と直交する方向に 切欠溝を形成し、次いで、セラミックスを被覆するヤン グ率の小さい側圧伝達筒と側圧負荷手段を有する圧力容 器とを備えるディスキング装置にセラミックスを挿入 し、前記切欠溝の位置が前記側圧伝達筒の端面から外方 に適宜の長さ突出するようにセラミックスを配置し、前 記ディスキング装置の側圧負荷手段によりセラミックス 10 の外周面の切欠溝から適宜の間隔を置いた位置に側圧を 負荷することによりセラミックスを前記切欠溝位置で切 断するので、刃物による切断の欠点を解消し、切屑や騒 音を発生させる虞れがなく、作業環境を悪化させる虞れ がなく、簡易迅速に円筒状のセラミックスを小さな力で 一瞬に切断することができ、平滑な切断面を得ることが できる。

【0049】本発明によれば、刃物による切断の欠点を解消し、切屑や騒音を発生させる虞れがなく、作業環境を悪化させる虞れがなく、簡易迅速に円筒状のセラミッ 20 クスを一瞬に切断することができ、切断に要するエネルギーを減少させることができ、切断面が平滑で経済性に優れた円筒状のセラミックスの切断方法を得ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る円筒状のセラミックスの切断方法に用いられるディスキング装置の断面図。

【図2】本発明に係る円筒状のセラミックスの切断方法の概略を示す断面説明図。

【図3】本発明に係る円筒状のセラミックスの切断方法 30 を示すもので、(a)は試験結果を示す表、(b)は切断面の状態を示す説明図。

【図4】本発明に係る円筒状のセラミックスの切断方法 を示す斜視説明図。 \*【図5】本発明に係る円筒状のセラミックスの切断方法の異なる実施の形態を示す断面説明図。

12

【図6】本発明に係る円筒状のセラミックスの切断方法の異なる実施の形態を示す斜視説明図。

### 【符号の説明】

- 1 ディスキング装置
- 3 圧力容器
- 5 円筒状のセラミックス
- 7 切欠溝
- 0 9 側圧伝達筒
  - 11 圧力負荷口
  - 13 0リング
  - 15 カラー
  - 17 保持環
  - 19 螺子
  - 21 ワイヤー
  - T 円筒状のセラミックス (ガラス瓶)
  - s 切欠き (円筒外周面に設けた場合)
  - W 引張荷重
- P 圧力容器に負荷する内圧(側圧伝達筒に負荷す

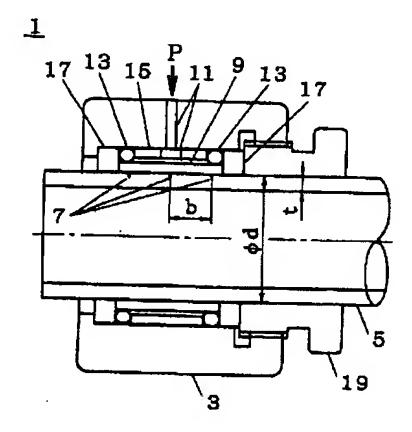
#### る側圧)

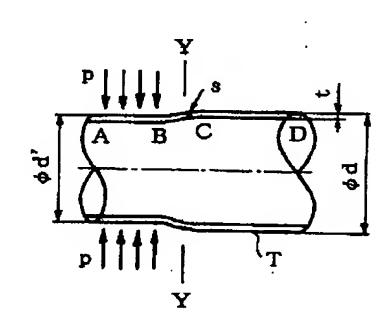
- d セラミックスの外径
- t セラミックスの肉厚
- b 切欠溝の間隔
- p セラミックスに負荷される側圧
- d´ 側圧により減少したセラミックスの外径
- X 側圧伝達筒の端面からの長さ
- P a 切断圧力
- δ 切断面の状態を示す最大距離
- 30 1 セラミックスの軸長
  - S 切欠き (円筒内周面に設けた場合)
  - K 滑車
  - R リング

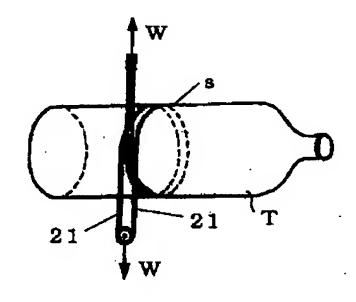
【図1】



【図4】





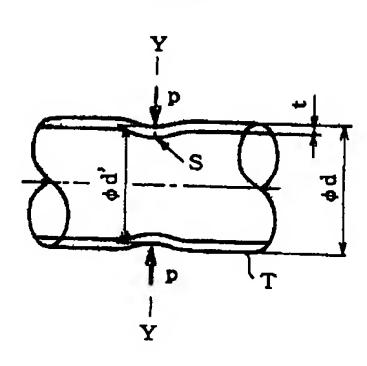


【図3】

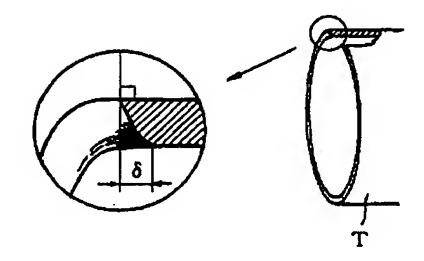
( **a** )

x (mm)	Pa (MPa)	# (mm)	带令
3.0	21.0	-4.0	đ
4.0	19.0	-3,0	4
6.0	18.5	-1.0	O
6.0	18.0	0	
7.0	18.5	0.5	b
8.0	19.0	1.5	Ь
9.0	19.5	2.0	b
10.0	20.5	2.5	b





(b)



[図6]

